# Kinetic Effects in RF Discharges

#### Philipp Hacker

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Physik Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

4. Dezember 2017

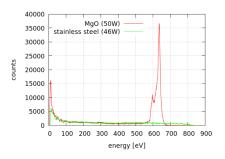
Betreuer: Prof. Dr. R. Schneider Gutachter: Prof. Dr. J. Meichsner

- 1. Motivation
- 2. Experiment
- 3. Particle-in-Cell Methode
- 4. 1D Simulation
- 5. Simulationen in 2D
- 6. Ausblick
- 7. Referenzen

# Kapazitive gekopplte RF-Plasmen



- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffer schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen

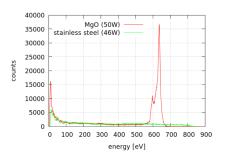


(Negative Ionen Energieverteilung in Sauerstoffentladungen) [2]

#### Kapazitive gekopplte RF-Plasmen



- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflachenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen

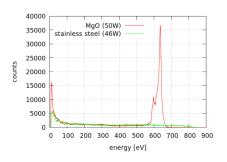


(Negative Ionen Energieverteilung in Sauerstoffentladungen) [2]

#### Kapazitive gekopplte RF-Plasmen

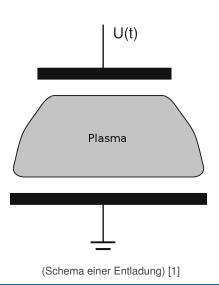


- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen Ionen



(Negative Ionen Energieverteilung in Sauerstoffentladungen) [2]



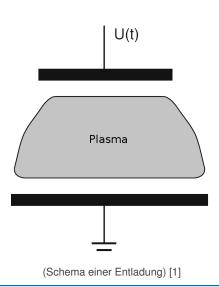


- negative Aufladung der Wände durch schnellere Elektronen
   →Self-Bias
- Ionen werden auf Bohm-Geschwindigkeit beschleunigt  $\sqrt{k_{\rm B}T_{\rm b}}$

$$v_{\mathsf{i},\mathsf{B}} = \sqrt{\frac{k_{\mathsf{B}}T_{\mathsf{e}}}{m_{\mathsf{i}}}}$$

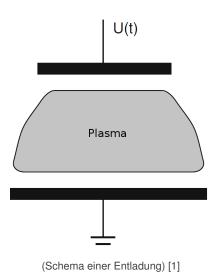
 Asymmetrie der getriebenen/geerden Elektroden





- negative Aufladung der Wände durch schnellere Elektronen →Self-Bias
- Ionen werden auf Bohm-Geschwindigkeit beschleunigt

$$v_{\mathsf{i},\mathsf{B}} = \sqrt{\frac{k_{\mathsf{B}}T_{\mathsf{e}}}{m_{\mathsf{i}}}}$$



 Ionen werden auf Bohm-Geschwindigkeit

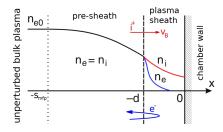
 negative Aufladung der Wände durch schnellere

beschleunigt  $v_{\mathsf{i},\mathsf{B}} = \sqrt{2}$ 

Elektronen →Self-Bias

 Asymmetrie der getriebenen/geerden Elektroden



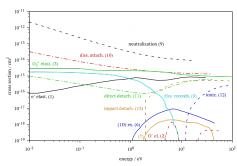


(Dichte und Potential vor einer Wand) [1]

 Kapazitive Kopplung führt zur Verschiebung des Plasma-Potentials Motivation Experiment Particle-in-Cell Methode 1D Simulation Simulationen in 2D Ausblick Referenzen

#### Oberflächen- und Stoßprozesse





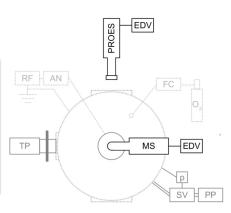
Nr.	Reaction	Type
	Electron and ion reactions	Creation and loss
(8)	$e^- + O_2^+ \rightarrow 2 O$	Dissociative recombination
(9)	$O^- + O_2^+ \rightarrow O_2 + O$	Neutralization
(10)	$e^- + O_2 \rightarrow O + O^-$	Dissociative attachment
(11)	$O^- + O_2 \rightarrow O + O_2 + e$	Direct detachment
(12)	$e^- + O_2 \rightarrow 2e^- + O_2^+$	Impact ionisation
(13)	$e^- + O^- \rightarrow O + 2e^-$	Impact detachment

(ausgewählte Stoßquerschnitte in Sauerstoff)

# Das Experiment



- große Asymmetrie zwischen geerdeter Kammer und CCRF-Elektrode
- niedrige Gasflüsse und -drücke (<5 sccm. 15 Pa)</li>
- Flektrodenabstand ~5 cm

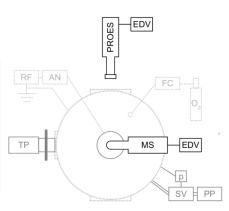


(Draufsicht des Experimentes) [2]

# Das Experiment



- große Asymmetrie zwischen geerdeter Kammer und CCRF-Elektrode
- niedrige Gasflüsse und -drücke (<5 sccm, 15 Pa)
- Flektrodenabstand ~5 cm

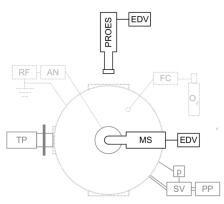


(Draufsicht des Experimentes) [2]

## Das Experiment

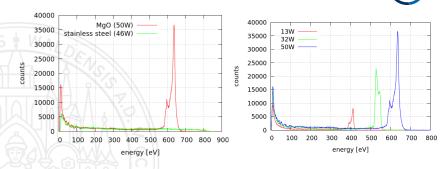


- große Asymmetrie zwischen geerdeter Kammer und CCRF-Elektrode
- niedrige Gasflüsse und -drücke (<5 sccm, 15 Pa)
- Elektrodenabstand ~5 cm



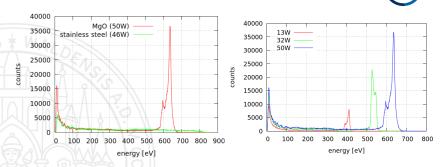
(Draufsicht des Experimentes) [2]





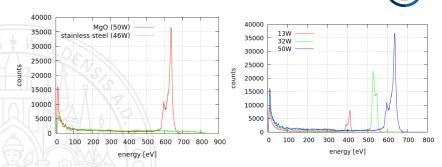
Struktur in EVF der negativen Ionen in Sauerstoff, Scheuer et. al [2] Hochenergetische Spitze in Abhängigkeit der Leistung und Material





Struktur in EVF der negativen Ionen in Sauerstoff, Scheuer et. al [2] Hochenergetische Spitze in Abhängigkeit der Leistung und Material

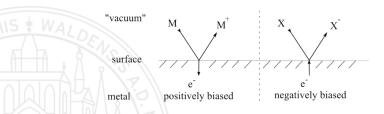




Struktur in EVF der negativen Ionen in Sauerstoff, Scheuer et. al [2] Hochenergetische Spitze in Abhängigkeit der Leistung und Material 

Anionen von der Elektrode?

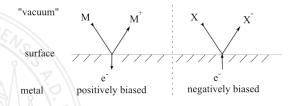




Saha-Langmuir Gleichung:

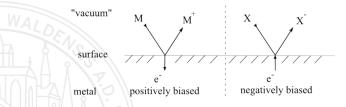
Ionisation hängt von Austrittsarbeit, Ionisationsenergie, Oberflächentemperatur, Spannung und quantenmechanischen Koeffizienten des Materials ab





Saha-Langmuir Gleichung: Ionisation hängt von Austrittsarbeit, Ionisationsenergie, Oberflächentemperatur, Spannung und quantenmechanischen Koeffizienten des Materials ab



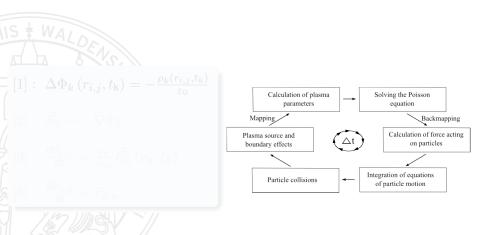


Saha-Langmuir Gleichung:

lonisation hängt von Austrittsarbeit, lonisationsenergie,

Oberflächentemperatur, Spannung und quantenmechanischen
Koeffizienten des Meteriele ab





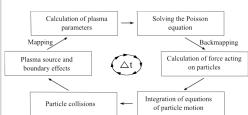




$$[2]: \vec{E}_k = -\vec{\nabla}\Phi_k$$

$$[3]: \frac{\operatorname{d}\vec{v}_{k,n}}{\operatorname{d}t} = \frac{q_n}{m_n} \vec{E}_k \left( r_n, t_k \right)$$

$$[4]: \frac{d\vec{x}_{k,n}}{dt} = \vec{v}_{k,n}$$



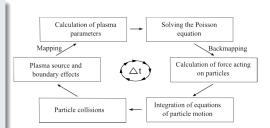


[1]: 
$$\Delta \Phi_k (r_{i,j}, t_k) = -\frac{\rho_k(r_{i,j}, t_k)}{\varepsilon_0}$$

$$[2]: \vec{E}_k = -\vec{\nabla}\Phi_k$$

$$[3]: \frac{\operatorname{d}\vec{v}_{k,n}}{\operatorname{d}t} = \frac{q_n}{m_n} \vec{E}_k \left( r_n, t_k \right)$$

$$[4]: \frac{d\vec{x}_{k,n}}{dt} = \vec{v}_{k,n}$$



Referenzen

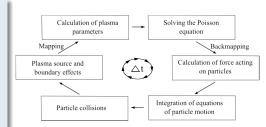


[1]: 
$$\Delta \Phi_k \left( r_{i,j}, t_{\mathbf{k}} \right) = -\frac{\rho_k(r_{i,j}, t_k)}{\varepsilon_0}$$

$$[2]: \vec{E}_k = -\vec{\nabla}\Phi_k$$

$$[3]:\ \frac{\mathrm{d}\vec{v}_{k,n}}{\mathrm{d}t} = \frac{q_n}{m_n}\vec{E}_k\left(r_n,t_k\right)$$

$$[4]: \frac{\mathrm{d}x_{k,n}}{\mathrm{d}t} = \vec{v}_{k,n}$$

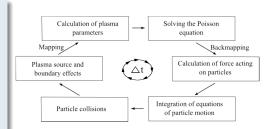


[1]: 
$$\Delta \Phi_k (r_{i,j}, t_k) = -\frac{\rho_k(r_{i,j}, t_k)}{\varepsilon_0}$$

$$[2]: \vec{E}_k = -\vec{\nabla}\Phi_k$$

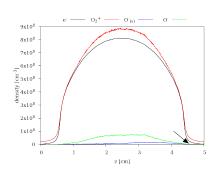
$$[3]:\ \frac{\mathrm{d}\vec{v}_{k,n}}{\mathrm{d}t} = \frac{q_n}{m_n}\vec{E}_k\left(r_n,t_k\right)$$

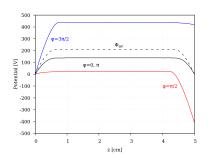
$$[4]: \frac{d\vec{x}_{k,n}}{dt} = \vec{v}_{k,n}$$



#### 1D Simulation







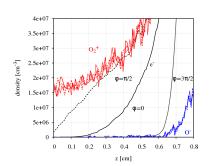
(Entladung bei 5 Pa und 400 V)

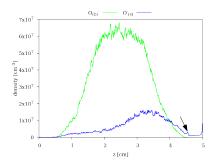
Dichte und phasenaufgelöstes Potential in 1D mit Injektion negativer lonen von der Kathode

$$\Rightarrow \eta = I(O^{-})/I(O_{2}) = 0.03$$

# 1D Simulation





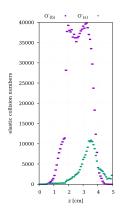


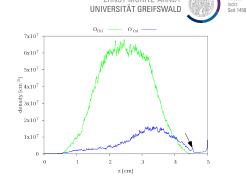
(Entladung bei 5 Pa und 400 V)

Dichte und phasenaufgelöstes Potential in 1D mit Injektion negativer Ionen von der Kathode

$$\Rightarrow \eta = I(O^{-})/I(O_{2}) = 0.03$$





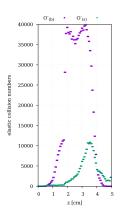


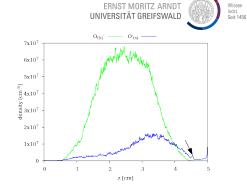
FRNST MORITZ ARNOT

⇒ Schicht nicht vollständig stoßlos

Dynamik der schnellen negativen Ionen von der gegenueberliegenden Elektrode stark durch elastische Stöße mit O₂ beeinflusst

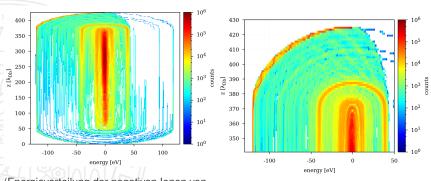
Wissen





 $\Rightarrow$  Schicht nicht vollständig stoßlos Dynamik der schnellen negativen Ionen von der gegenueberliegenden Elektrode stark durch elastische Stöße mit  $O_2$ beeinflusst



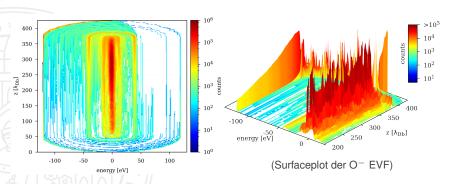


(Energieverteilung der negativen lonen von der Oberfläche)

(Anodenbereich der EVF von O<sup>-</sup>)

hochenergetische Struktur bei  $\sim \! 100\, {\rm eV}$  vor Anode, abnehmend zur Kathode mit mittlerer freien Weglänge der O $^-$ 

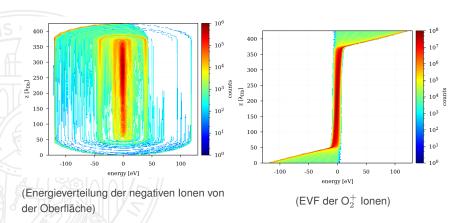




(Energieverteilung der negativen lonen von der Oberfläche)

hochenergetische Struktur bei  $\sim$ 100 eV vor Anode, abnehmend zur Kathode mit mittlerer freien Weglänge der O $^-$ 



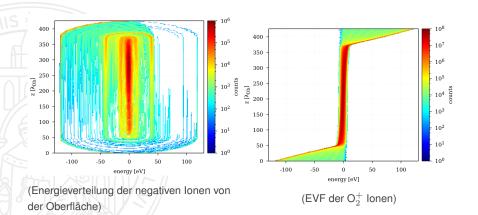


langsame Ionen im Bulk der Entladung  $\rightarrow$  schnelle O $^-$  abgebremst und kehren in Randschicht um

Motivation Experiment Particle-in-Cell Methode 1D Simulation Simulationen in 2D Ausblick Referenzen

# Dynamik negativer lonen



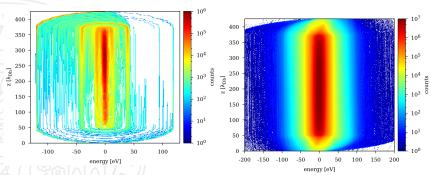


Struktur über großen Energiebereich vor den Elektroden?

Motivation Experiment Particle-in-Cell Methode 1D Simulation Simulationen in 2D Ausblick Referenzen

# Dynamik negativer lonen



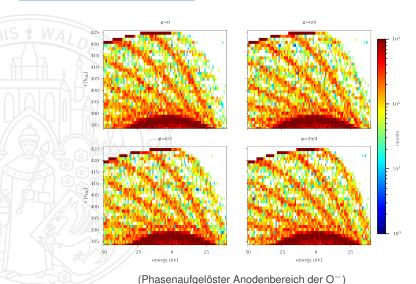


(Energieverteilung der negativen lonen von der Oberfläche)

(EVF der Elektronen)

Struktur über großen Energiebereich vor den Elektroden? bei Elektronen keine sichtbar!

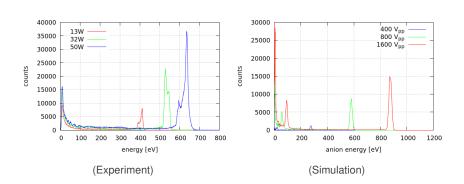




(1 Haseriaalgelostel Allodelibereleit del O

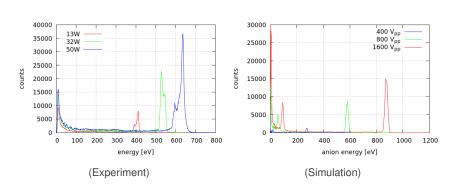
# **Experiment-Vergleich**





 bisher: Vermutung für hochenergetische Struktur in O<sup>-</sup> EVF im Vergleich zu Experiment bestätigt Motivation Experiment Particle-in-Cell Methode 1D Simulation Simulationen in 2D Ausblick Referenzen

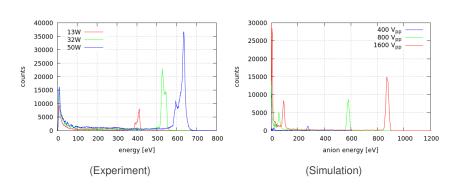
# **Experiment-Vergleich**



 Spannungsvariation zeigt Abhängigkeit der Energieverteilung der Oberflächenprozesse Motivation Experiment Particle-in-Cell Methode 1D Simulation Simulationen in 2D Ausblick Referenzen

## **Experiment-Vergleich**





niederergetische Struktur nicht in Experiment zu finden

#### Simulationen in 2D





# Vergleich mit 1D





# Negative Ionen EVF





#### Asymmetrische Ranbedingungen





#### Einfluss des Self Bias





#### **Ausblick**





#### Referenzen



